### 06;07;12

# Длинноволновые неохлаждаемые источники излучения $\lambda = 5-6 \,\mu$ m на основе градиентных слоев InAsSb(P), полученных методом жидкофазной эпитаксии

### © М. Айдаралиев, Н.В. Зотова, С.А. Карандашев, Б.А. Матвеев, М.А. Ременный, Н.М. Стусь, Г.Н. Талалакин

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе, С.-Петербург

#### Поступило в Редакцию 18 ноября 1997 г.

Сообщается о получении и исследовании градиентных p-n-структур InAsSb/InAsSbP/InAs, способных излучать в максимуме спектральной кривой до 5.4  $\mu$ m и полушириной спектра  $\sim 26 \,\mathrm{meV}~(\sim 0.6\,\mu\mathrm{m})$  без охлаждения. На сегодняшний день это самое длинноволновое излучение, полученное при комнатной температуре в структурах III–V, выращенных методом жидкофазной эпитаксии, и самое узкополосное среди полупроводниковых спонтанных источников излучения.

В последнее время интенсивно исследуются материалы и гетероструктуры, обеспечивающие излучательные переходы с длинами волн  $\lambda > 5 \,\mu$ m при комнатной температуре. Светодиоды в указанном диапазоне найдут применение в спектроскопии, газовом анализе и связи.

Усилия многих исследователей направлены на изучение возможностей материалов III–V, поскольку последние обладают высокой теплопроводностью и металлургической стабильностью по сравнению с системами II–VI и IV–VI. В работе [1] сообщалось о создании методом молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ) светодиода InSb/In<sub>1-x</sub>Al<sub>x</sub>Sb с полушириной спектра излучения > 1  $\mu$ m ( $\lambda = 5.5 \mu$ m), что для ряда задач спектроскопии не является оптимальным. Недавно, также методом МЛЭ, были созданы квантово-каскадные светодиоды в диапазоне 5–8  $\mu$ m [2], которые, однако, не обладают способностью работать в непрерывном режиме.

88

Альтернативой являются гетероструктуры, содержащие твердый раствор InAsSb, имеющий ширину запрещенной зоны от 350 до ~ 100 meV (300 K). Однако ввиду отсутствия бинарной подложки, согласованной по параметру решетки с InAsSb необходимого состава, возникает необходимость в наращивании промежуточных (переходных) слоев между подложкой и рабочим слоем требуемого состава [3] либо в создании напряженных сверхрешеток [4]. В первом случае длины волн в максимуме полосы не превышали  $\lambda = 4.4 \,\mu$ m, а во втором — были получены светодиоды с полушириной спектра излучения > 1  $\mu$ m (300 K).

Ранее [5] нами был предложен метод получения твердых растворов InAsSb с низкой плотностью дислокаций ( $N < 10^4$  cm<sup>-2</sup>) и с возрастающим к поверхности содержанием Sb, включающий выращивание методом жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) градиентного слоя InAsSbP в условиях высокой пластичности подложки InAs, что обеспечивает релаксацию напряжений несоответствия за счет преимущественного образования дислокаций в подложке, сопровождаемого ее изгибом. Этот метод был применен для получения светодиодов с максимумом спектра электролюминесценции при 4.3 и 4.7  $\mu$ m и полушириной не более 0.5  $\mu$ m (300 K) [6], использованных в сенсорах, чувствительных к углекислому и угарному газам соответственно [7]. С его помощью были также получены узкозонные слои InAs<sub>0.46</sub>Sb<sub>0.54</sub> с резким краем оптического поглощения при 90 meV (300 K). До сих пор, однако, этот метод не применялся для создания p-n-структур, излучающих при  $\lambda > 4.8 \mu$ m (300 K).

Целью данной работы являлось исследование механизмов излучательной рекомбинации в гетероструктурах InAsSb/InAsSbP/InAs, полученных методом ЖФЭ в условиях высокой пластичности подложки, и создание источников излучения, работающих без охлаждения в диапазоне  $5-6 \,\mu$ m.

Гетероструктуры InAs<sub>1-x</sub>Sb<sub>x</sub>(Zn)/InAsSbP/InAs (вставка к рис. 1) были получены методом ЖФЭ при температурах 630–680°С на подложках *n*-InAs (111) с концентрацией электронов ~  $2 \cdot 10^{16}$  сm<sup>-3</sup>. *P*-*n*-переход создавался в процессе роста легированного Zn слоя InAsSb в атмосфере очищенного водорода. Плотность наклонных дислокаций в поверхностном слое не превышала  $5 \cdot 10^4$  сm<sup>-2</sup>. Основная часть дислокаций, вызванная несоответствием параметров решетки подложки и твердого раствора, находилась в подложке и на интерфейсе InAs/InAsSbP, вдали от *p*-*n*-перехода и излучающей области.



Рис. 1. Спектры ФЛ (77 К) структур № 1 (*a*) и № 2 (*b*).

Фото- (ФЛ) и электролюминесценция (ЭЛ) регистрировались охлаждаемым InSb фотодиодом по схеме синхронного детектирования. При возбуждении ФЛ использовался диодный GaAs лазер ЛПИ-14 ( $\lambda = 0.8 \,\mu$ m,  $P_{\text{puls}} \sim 10 \,\text{W}$  ( $\tau = 5 \,\mu$ s,  $f = 500 \,\text{Hz}$ )), излучение которого направлялось на узкозонный слой InAsSb в геометрии "на отражение". Для измерения ЭЛ выкалывались образцы  $0.5 \times 0.5 \times 0.2 \,\text{mm}$ , которые монтировались узкозонным слоем InAsSb на основание держателя. Токовые выводы к кристаллу припаивались индием, излучение выводилось через слой InAsSbP и подложку InAs.

На рис. 1 представлены спектры ФЛ (77 К) структур с составом в узкозонном поверхностном *p*-слое  $x_1 = 0.1$  (№ 1-218(5)) и  $x_2 \sim 0.2$  (№ 2-232(2)), которые в дальнейшем будем называть образцами № 1 и № 2 соответственно. Интенсивность ФЛ в более узкозонном твердом растворе ( $x_2 \sim 0.2$ ) в 5 раз слабее, чем для состава с  $x_1 = 0.1$ , что согласуется с данными работы [8]. Характеристическая энергия коротковолнового спада  $\varepsilon_0 \sim 10$  meV близка к тепловой энергии kT при 77 К, что свидетельствует о высоком структурном совершенстве полученных слоев. Поэтому большая полуширина спектра ( $\sim 26$  meV)



**Рис. 2.** *а* — вольт-амперные характеристики (77, 300 K); *b* — спектры ЭЛ структур № 1: 77 К (*1*), 300 К (*1а*) и № 2: 77 К (*2*), 300 К (*2а*).

связана, вероятно, с участием в излучательной рекомбинации двух каналов: зона-зона и зона-акцептор.

На рис. 2, *а* представлены вольт-амперные характеристики при 77 и 300 К. Как видно, с увеличением содержания сурьмы напряжение отсечки убывает от  $U_{\text{cut}} = 0.306 \text{ V} (x_1 = 0.1)$  до  $U_{\text{cut}} = 0.226 \text{ V} (x_2 \sim 0.2)$  (77 К), отслеживая уменьшение энергии ширины запрещенной зоны твердого раствора.

На рис. 2, *b* приведены спектры ЭЛ ( $\tau = 5 \,\mu$ m,  $f = 500 \,\text{Hz}$ ,  $I = 3 \,\text{A}$ ) при 77 и 300 K, скорректированные с учетом падения чувствительности фотоприемника при  $\lambda > 5 \,\mu$ m. Аналогичные спектры были получены и в непрерывном режиме. С увеличением температуры (от 77 до 300 K) спектры ЭЛ сдвигаются в сторону меньших энергий, а интенсивность излучения падает аналогично данным работы [8]: для образца № 1 в  $\sim 300 \,\text{раз}$  и в 16 раз для образца № 2. Обращает на себя внимание



Рис. 3. Температурные зависимости энергии максимума (кривая *1*), интенсивности (кривая *4*) ЭЛ структуры № 2,  $E_g(T) = hv_{max}(T) - kT/2$  (кривая *2*),  $E_g(T) = E_g(0) - 2.85 \times 10^{-4} \times T \text{ meV}$  ( $E_g(0)$  — подгоночный параметр) (кривая *3*).

слабое изменение полуширины спектра, которая при 300 К оказывается порядка ~ kT. На рис. 3 приведены зависимости энергии максимума (кривая I) и интенсивности (кривая 4) ЭЛ структуры с узкозонным твердым раствором InAs<sub>0.8</sub>Sb<sub>0.2</sub> (№ 2) от температуры. При T = 175 К в зависимости hv(T) наблюдается излом и увеличение скорости температурного дрейфа максимума ЭЛ до ~ 0.26 meV/K (T = 175-300 K). Отметим, что из-за большой подвижности электронов, в p-n-переходе излучающей областью является p-область структуры.

Мы предполагаем, что в излучательной рекомбинации участвуют два канала: зона–акцептор и зона–зона. Их суперпозиция приводит к достаточно широкому спектру при низкой температуре ( $\Delta hv_{1/2} \sim 25$  meV, 77 K). Энергия акцепторного уровня, связанного с введением Zn,  $\sim 15$  meV, поэтому можно ожидать, что с повышением температуры будет происходить насыщение акцепторного уровня и при T > 170 K будет преобладать рекомбинация зона–зона. Для анализа температурной зависимости будем считать, что форма спектра люминесценции для приближения параболических зон в отсутствие вырождения носителей

заряда имеет вид:  $I(hv) \sim \sqrt{hv - E_g} \cdot \exp[-(hv - E_g)/kT]$ , hv энергия фотона,  $E_g$  — ширина запрещенной зоны. Тогда энергия ширины запрещенной зоны будет на величину kT/2 меньше энергии пика люминесценции (это хорошо выполняется для бинарных соединений InAs и InSb и указывает на выполнение закона сохранения импульса). На рис. 3 мелким пунктиром (кривая 2) приведена температурная зависимость ширины запрещенной зоны тройного раствора InAs/InAs<sub>0.8</sub>Sb<sub>0.2</sub> в области преобладания рекомбинации зона-зона, полученная из экспериментальной зависимости  $hv_{max} = f(T), E_g(T) = hv_{max}(T) - kT/2$ . Ее наклон совпадает с наклоном температурного изменения ширины запрещенной зоны InAs:  $E_g(T) = E_g(0) - 2.85 \times 10^{-4} \times T$  [meV] (кривая 3, рис. 3), что говорит о высоком кристаллическом совершенстве эпитаксиального слоя, не содержащем беспорядка, который мог бы нарушить закон сохранения волнового вектора [8].

Таким образом, в работе получены и исследованы градиентные p-n-структуры InAsSb/InAsSbP/InAs, способные излучать в максимуме спектральной кривой до 5.4  $\mu$ m и полушириной спектра ~ 26 meV (~ 0.6  $\mu$ m) без охлаждения. На сегодняшний день это самое длинноволновое излучение, полученное при комнатной температуре в структурах III–V, выращенных методом ЖФЭ, и самое узкополосное среди полупроводниковых спонтанных источников излучения. Такие структуры могут стать основой для создания эффективных светодиодов, работающих при комнатной температуре и используемых для спектроскопии ряда газов, например окиси азота (NO).

В заключение авторы выражают благодарность Ю.П. Яковлеву за внимание и интерес к работе, Т.И. Ворониной, М.Е. Виноградовой, А.В. Луневу и Н.Д. Ильинской за техническую помощь, оказанную при выполнении работы.

## Список литературы

- Ashley T., Eliott C.T., Gordon N.T., Hall R.S., Johnson A.D., Pryce G.J. // Appl. Phys. Lett. 1994. V. 64. N 18. P. 2433–2435.
- [2] Rui Q. Yang, Chih-Hsiang Lin, Murry S.J., Pei S.S., Liu H.C., Buchanan M., Dupont E. // Appl. Phys. Lett. 1997. V. 70(15). P. 2013–2015.
- [3] Gong X.Y., Yamaguchi T., Kan H., Makino T., Rowell N.L., Lacroix Y., Mangyou A., Aoyama M., Kumagawa M. // Jpn. J. Appl. Phys. 1997. V. 36. N 2. P. 738–742.

- [4] Tang P.J., Pullin M.J., Philips C.C., Stradling R.A., Norman A.G, Li Y.B., Hart L. // Semicond. Sci. Technol. 1995. V. 10. P. 1177–1180.
- [5] Матвеев Б.А., Стусь Н.М., Талалакин Г.Н. // Кристаллография. 1988. Т. 32.
  В. 1. С. 216–221.
- [6] Айдаралиев М., Зотова Н.В., Карандашев С.А., Матвеев Б.А., Стусь Н.М., Талалакин Г.Н. // Письма в ЖТФ. 1991. Т. 17. В. 23. С. 75–79.
- [7] Matveev B.A., Gavrilov G.A., Evstropov V.V., Zotova N.V., Karandashov S.A., Sotnikova G.Yu., Stus N.M., Talalakin G.N., Malinen J. // Sensors and Actuators. 1997. V. 38–39. P. 339–343.
- [8] Fang Z.M., Ma K.J., Jaw D.H., Cohen R.M., Stringfellow G.B. // J. Appl. Phys. 1990. V. 67. N 11. P. 7034–7039.